

レーザーマイクロゲージ LMG-IIシリーズ

センサ部 製品仕様

| 項目 | モデル名 | LMG 016 II | LMG 126 II | LMG 300 II | LMG 305 II | LMG 606 II | LMG 800 II | LMG 805 II | LMG 1505 II | LMGW 2205 II |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 使用レーザー | | 可視半導体レーザー (670nm) | | | | | | | | |
| 測定物の大きさ (mm) | | 0.01 - 2 | 0.05 - 12 | 0.2 - 30 | 0.2 - 30 | 0.5 - 60 | 0.5 - 80 | 0.5 - 80 | 0.7 - 150 | 0.7 - 220 |
| 最小表示値 | (μm) | 0.05 | | | | 0.1 | | | 1 | 1 |
| | (インチ) | 0.00005 | | | | 0.0001 | | | 0.001 | 0.001 |
| 測定精度*1 | 再現性 (μm) | ± 0.5 | ± 1 | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ± 5 | ± 12 (± 5)*2 | ± 15 (± 5)*3 |
| | 直線性 (μm) | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 4 | ± 8 (± 4)*2 | ± 12 (± 4)*3 |
| | 繰返 (μm) | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 1 | ± 2 (± 1)*2 | ± 2 (± 1)*3 |
| 測定回数 (回/s) | | 1800 | | | | | | | | |
| レーザー走査速度 (m/s) | | 42 | 110 | 175 | 175 | 350 | 350 | 420 | 560 | 420 |
| 周囲温度 (°C) | | 0 ~ 45 | | | | | | | | |
| 質量 (kg) | 送光部 | | | 1.7 | | 2.2 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 20.0 |
| | 受光部 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
| | 設置台 | | | 1.5 | | 1.6 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 7.0 |
| 質量合計 (kg) | | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 3.0 | 4.8 | 12.0 | 9.0 | 16.5 | 33.0 |

*1 測定可能領域の70%以内において周囲温度 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 、平均回数896回(表示間隔0.5秒)以上での値。

(± 1 デジタルの量子化誤差は含まず)

総合精度：上記の条件で、どの位置で測定しても得られる精度。

直線性：上記の条件で測定領域センターで標準ゲージのサイズを変えて測定した場合の精度。

繰返精度：上記の条件で同じ位置で同一標準ゲージを繰返し測定した場合の精度。

*2 ()内は80mmまでの測定精度。

*3 ()内は下部測定領域での測定精度。

※LMGW2205IIはダブルビーム専用のPII表示部との組合せとなります。